

# 公差配合与技术测量



[公差配合与技术测量 下载链接1](#)

著者:张岐生

出版者:大连理工大学出版社

出版时间:2006-8

装帧:平装

isbn:9787561132586

《公差配合与技术测量》是中等职业学校机械类专业的规划教材。《公差配合与技术测量》共分绪论，光滑孔、轴尺寸的公差与配合，技术测量基础，形状和位置公差及检测，表面粗糙度，光滑极限量规及典型零件的公差及检测共七章。遵循实用、够用的原则，以应用为主，在光滑孔、轴的公差与配合，技术测量基础，形状和位置公差及表面粗糙度的基础上，采取项目教学的方式介绍几种常见零件图的识读及零件的检测方法，为今后学习其他专业课和中级技能人才培训打下坚实的基础。

作者介绍:

目录:

[公差配合与技术测量 下载链接1](#)

标签

评论

---

[公差配合与技术测量 下载链接1](#)

书评

---

[公差配合与技术测量 下载链接1](#)